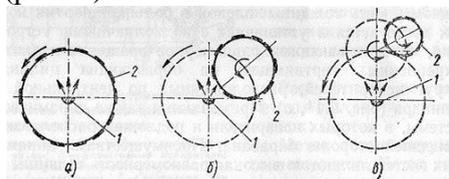


## РАЗРАБОТКА ОСНАСТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛИНЗ ПРИ НАПЫЛЕНИИ СВЕТООТДЕЛИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

БНТУ, г. Минск

*Научный руководитель: Комаровская В.М.*

В настоящее время в оптической промышленности просветляющие покрытия на линзах получают в основном методом термического напыления в вакууме. При этом одним из основных требований, предъявляемым к данным покрытиям является равномерность толщины пленки по поверхности линзы [1]. Равномерность толщины пленок можно повысить за счет увеличения расстояния между испарителем и подложкой, но при этом уменьшается скорость напыления, а так же следует учитывать, что рабочая камера установки имеет ограниченные размеры. Высокой равномерности толщины пленок по поверхности деталей добиваются, применяя приемные устройства сферической формы или динамические системы приемных устройств, вращающиеся относительно неподвижных испарителей (рис. 1).



а – карусельное; б – планетарное; в – спутниковое;

1 – нагреватели; 2 – подложки

Рисунок 1 – Основные виды вращения  
подложкодержателей

Поэтому при разработке технологической оснастки для установки линз в вакуумной камере равномерность толщины

